

# GGK-LF500.

La sorgente plasma AC che sostituisce la RF e l'alta tensione DC: scarica più stabile, nessuna rete di adattamento, costi nettamente inferiori.



**500 W**

Potenza a 50 kHz

**50 kHz**

Frequenza, sinusoidale

**250÷1500  $\Omega$**

Impedenza regolabile

**~2 kg**

Peso, ultracompatto

# L'alternativa intelligente a RF e alta tensione DC

Il **GGK-LF500** è una sorgente plasma AC che eroga **500 watt a 50 kHz** con forma d'onda sinusoidale, controllabile via PC o PLC. Un generatore "black box" pensato per chi vuole gestire l'alimentazione del plasma in modo semplice, diretto e ripetibile.

In molte applicazioni il GGK-LF500 sostituisce la radiofrequenza con **costi nettamente inferiori** e meno problemi di messa a punto, ed è l'alternativa ideale alle sorgenti DC ad alta tensione nelle scariche a bagliore: la scarica è molto più **stabile**, senza formazione di cariche localizzate.

Grazie al sistema di misura integrato e al controllo digitale avanzato, è la scelta ideale per lo **sputtering di materiali dielettrici** e per i processi PECVD, sia in ricerca che in produzione.



Pannello con diagnostica a LED: RF on/off, limite potenza, limite corrente, arco.

## Nessun matching

Collegamento diretto all'elettrodo; niente rete di adattamento da tarare.

## Misure integrate

Tensione RMS, DC self bias e potenza disponibili sulla user port.

## Arc detection attiva

Rilevamento e spegnimento degli archi per una scarica sempre pulita.

## Controllo via PC/PLC

Generatore "black box" con controllo digitale avanzato e ripetibile.

## — PERCHÉ SCEGLIERLO

# Tutti i vantaggi, nessun compromesso

### Piena potenza, ogni impedenza

I 500 W sono disponibili sull'intero range di impedenza senza dover regolare prese di trasformatore. Un solo strumento copre carichi diversi, dal dielettrico al conduttivo, senza interventi manuali.

### Protezione totale

Circuito di protezione completo contro sovratemperatura, sovratensione e con limitazione della potenza d'uscita. Affidabilità da processo produttivo, giorno dopo giorno.

*Più stabile. Più economico. Più semplice.*

## Dove lavora il GGK-LF500

- **Scariche a bagliore** in sostituzione dei generatori DC convenzionali.
- **Deposizione PECVD** con scarica stabile e ripetibile.
- **Sputtering** di piccoli catodi e di target dielettrici.
- **Sorgente di BIAS** per sistemi ICP.
- **Pulizia e attivazione** delle superfici tramite plasma.
- **Produzione** di reattori PVD e PECVD, ricerca e sviluppo.

CAMPI DI IMPIEGO

### PVD

Reattori PVD

### PECVD

Plasma-Enhanced CVD

### ICP

Sorgente di bias

### R&D

Ricerca e sviluppo

## Specifiche

### DIMENSIONI

Ingombro	340 P × 150 L × 120 H mm
Peso	circa 2 kg

### USCITA

Potenza	500 W a 50 kHz
Forma d'onda	Sinusoidale
Impedenza	250 ÷ 1500 Ω
Piena potenza	Su tutto il range

### COLLEGAMENTO

Tipo	Diretto all'elettrodo
Rete di adattamento	Non richiesta

### SISTEMA DI MISURA

Integrato	Completo e accurato
Letture	V RMS, DC self bias, potenza
Disponibili su	User port

### SICUREZZA

Arc detection	Attiva, con quenching
Protezioni	Sovratemp., sovratens.
Potenza d'uscita	Limitazione attiva

### CONTROLLO

Interfaccia	PC o PLC
Tipo	Digitale avanzato

### CONFORMITÀ

Certificazione	CE Marked
----------------	-----------